【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2003-242879(P2003-242879A)
【公開日】平成15年8月29日(2003.8.29)
【出願番号】特願2002-40025(P2002-40025)
【国際特許分類第７版】
　ＨＯ１Ｊ　 9/02
　ＨＯ１Ｊ　11/02
【ＦＩ】
　ＨＯ１Ｊ　 9/02　　Ｆ
　ＨＯ１Ｊ　11/02　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成16年11月30日(2004.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】プラズマディスプレイパネルの製造方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板に誘電体層形成用ペーストを塗布し、前記塗布した誘電体層形成用ペーストを加圧下で乾燥することにより前記ガラス基板上に膜を形成し、前記形成された膜を焼成して誘電体層を形成することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。
【請求項２】
　誘電体層形成用ペーストを塗布する時の圧力より誘電体層形成用ペーストを乾燥する時の圧力が高いことを特徴とする請求項１記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。
【請求項３】
　誘電体層形成用ペーストの塗布、乾燥および焼成をこの順序で複数回繰り返して誘電体層を形成することを特徴とする請求項１または２記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。
【請求項４】
　誘電体層形成用ペーストの塗布および乾燥をこの順序で複数回繰り返して膜を積層し、その後、積層した膜を焼成して誘電体層を形成することを特徴とする請求項１または２記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。
【請求項５】
　誘電体層形成用ペーストの塗布は大気圧下で行い、誘電体層形成用ペーストの乾燥は３～８ｋｇ／ｃｍ^{2}下で行うことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。